

# Patent Abstracts of Japan

**PUBLICATION NUMBER** 

55003613

**PUBLICATION DATE** 

11-01-80

APPLICATION DATE

21-06-78

APPLICATION NUMBER

53074199

APPLICANT: HITACHI TOKYO ELECTRONICS CO

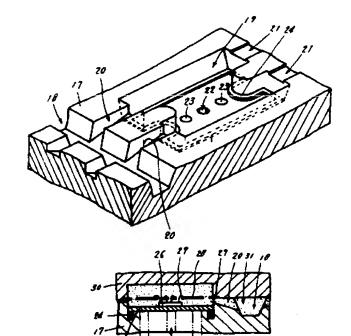
INVENTOR: YOSHIDA HISASHI;

INT.CL.

: H01L 23/30 B29G 3/00

TITLE

: RESIN MOULD DEVICE



ABSTRACT: PURPOSE: To prevent the occurrence of resin flash by disposing a vacuum adhesion hole for attracting a moulded article on a contact portion in a cavity formed within a moulding die with an article to be moulded, in order to make flash elimination operation unnecessary.

> CONSTITUTION: A groove-like runner 18, a hollow cavity 19, sub-runners 20 communicating therebetween, and an air vent 21 opposite to the runner 18 to cause air to escape are disposed on a lower moulding die. Installed also on the bottom surface of the cavity 19 are a vacuum adhesion hole 22 for attracting a header 25 to be held therein, and pins 23 for ejectors. In addition, a packing 24 made of, for example, silicone rubber is provided along the peripheral wall of the cavity 19. Within the cavity 19 is accommodated a header 25 on which semi-finished circuit elements are mounted. And, after the header 25 has been vacuum attracted through the hole 22, an upper die is placed thereon and then a molten resin is injected. In this construction, the molten resin is prevented from flowing into the lower surface of the header 25 at the time of moulding, so that no flesh occurs.

COPYRIGHT: (C) JPO

This Page Blank (uspic)

(19) 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭55-3613

⑤Int. Cl.<sup>3</sup> H 01 L 23/30 B 29 G 3/00 識別記号

庁内整理番号 7738-5F 6704-4F 砂公開 昭和55年(1980)1月11日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

⊗レジンモールド装置

②特

⑫発

顧 昭53-74199

②出 願 昭53(1978)6月21日

子株式会社内

①出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内一丁目 5

番1号

⑪出 願 人 日立青梅電子株式会社

青梅市今井1737番地

個代 理 人 弁理士 薄田利幸

## 男 細 書

発明の名称 レジンモールド装置

## 特許請求の範囲

1. モールド型のキャビティの一面に接触する接触部を有する被モールド物をモールドするレジンモールド装置において、被モールド物の接触部に対応するキャビティの一面に被モールド物を真空吸着する真空吸着孔を設けたことを特徴とするレジンモールド装置。

# 発明の詳細な説明

本発明はレジンモールド装置(モールド機)に 関する。

レツンモールド型半導体装置の対止(モールド) におけるモールド機としては、低圧トランスファ 成形機が一般に用いられている。このモールド機 では、第1回(A)に示すように、下金型1上にリー ドフレーム2を載置した後、浮動盤3を支柱4に 沿つて上昇させ、リードフレーム2を下金型1と 上金型5との間に挟む。その後、同四(b)に示すよ うに、投入電6から予備加熱した硬化剤とレジン

とからなるメブレットでをポットを内に入れる。 ポット8内に投入されたメブレット?は下金型1 の上面中央の宿みからなるカル9上に載り、とれ に対して同図(0)に示すようにブランジヤ10が下 降する。カル8上のメブレット7はブランジャ 10によつて押し渡され、港けて上・下金型5. 1によつて形作られたランナ11 , モールド空間 1 2 に流れ込み、リードフレーム 2 の所望部をレ ジンでモールドする。つぎに、モールド鉄、ブラ ンジヤ10を上昇させるとともに、浮遊盤3を降 下させて上・下金型5,1を互いに引き離す。と の際、図示しないエジエクタピンでモールド物 18を下金型1から突き出すようになつている。 ところで、このようなモールド根にあつては、 第2図(4)~(6)に示すよりな製品群を作る際のモー ルドではつぎのような難点がある。第8回は前記 製品群の一部を断面としたものを示すが、とれら の製品群の特徴としては、モールド時における被 モールド物の形態は、モールド型のパーテイング

面間に挟まれて挟持されるリーアフレーム(図で

特朗昭55-3613(2)

はリードフレームの枠部は切断除去されるため、 モールド部14から突出するリード18しか残つ ていない。)と、モールド質の下型のキャピティ の底面を接触するヘッダ16(熱伝導性の優れた 会属で形成される放熱板)とからなり、これらへ ッグ16とリードフレームの粋部(との粋部は一 部モールド部内に残留する。)とは連結片を介し て一体的に固定されている。前記連結片は幹部が ら延びかつ途中で下方に折れ曲がり、その先端平 **塩都をヘッダにカッメによつて固定している。と** のため、リードフレームの下面からヘッダ16の 下面に至る距離(探さ)が一定しにくくなり、キ ヤピティの底とヘッダ下面との間に空隙が生じ易 くなる。モールド時は若敷状態のレジンが加圧往 入されるため、レジンはとの空隙内にも入り込み、 モールド型から取り出した際、ヘッダに付着した ままとなる。これら製品群はモールド部の下面に 舞出したヘッダ面から熱を放散させるので、ヘッ ダに付着したレジン(これをレジンフラッシュま たはパリと云う。)を除去する必要が生じ、従来

モールド後には非生産的なべり取り作業を行なつ ていた。

したがつて本発明の目的は、レジンフラッシュ の生じないレジンモールド装置を提供することに ある。

とのよりな目的を達成するために本発明は、モールド型のパーティング面間に挟まれる被モールド物部分(支持部分)と、キャビティの一面に接触するような状態でモールド型にセットされる被モールド物部分(接触部)とを有する被モールド物をレジンモールドするレジンモールド接種にあつて、前配接触部に接触するキャビティの一面に接触部を真空吸引する真空吸着孔を設けてから。のであつて、以下実施例により本発明を説明する。

第4回は本発明のレジンモールド装置の一実施例、すなわちモールド型下援を示す。下型17の上面パーテイング面には、溶融レジンが圧送され流れる滞からなるランナ18と、僅からなるキャピティ19かよびランナ18とキャピティ19とを繋ぎレジンが流れる溶からなるサブランナ20

とが設けられている。また、サブランナの反対側 のキャピティ無無にはモールド空間のエアー(翌 気)が逃げるためのエアーペント21が設けられ ている。また、キャピティ18の底には並んで8 つの孔が設けられ、中央の孔は真空最着孔22を 形作り、図示はしないが真空ポンプ系に接続され るようになつている。また、両側の孔には第5回 で示すようにエジエクタピン28が挿入されてい る。また、キャピティ19の庶用銀に沿つて排が 設けられ、この溝にはパッキン2 4 が詰められて いる。このパフキン24の上面はキャピティ底面 よりもわずが突出していて、パッキン24の上面 にヘッダ25を載せ、真空長着孔28から真空に 引くことによつて幾み、キャピティ底面を同一面 となる。また、このパッキン24は必ずしもキャ ピティ森関係に沿つて設けられる必要はなく、キ ヤピティ面に接触する接触部となるヘッダ25の 金娘に対応する位置ならどのような枠形状でもよ い。ただし、ヘッダをキャピティ底面に真空長着 させる必要があることから神形状内には常に真空

吸着孔22が位置するようにしなければならない。 なか、前配パッキンの材質としては、モールド時 の高熱(たとえば200で程度)に耐えかつ弊性 を維持できるものでなければならない。たとえば、 シリコンゴム,テフロン(商標名),ポリフェニ レンサルフアイド徴脂(PPB,Texlook Packing いずれも商品名)を用いる。

つぎに、モールド状態について第5図を参照しながら説明する。

まず、ヘッダ25の中央上面に四路素子26を 固定し、ヘッダ25と平行でかつヘッダよりも上 方に位置するリードフレーム27のリード28の 先婦と回路素子26の電極とをワイヤ29で接続 した組立途中の半完成品を下型17上に較置する。 リードフレーム27部分は下型17のパーティン グ面に載り、ヘッダ25の下面は下型17のキャ ピティの底面に接触するような状態となる。そと で、真空教着孔22から真空に引いてヘッダ25 を下型キャピティの底面に告着させる。次いで、 上型80と下型17とを合せ(塑飾)、その後、 ランナ18からサブランナ20を介して上。下型のキャピティによつて形作られるモールド空間内に溶融レジン31を注入してモールドを行なう。モールド後、辺隣をし、真空吸着を停止させ、エジェクタピン23を上昇させてモールド部を持し上げ、下型からモールド銀品を抜き出し、一回のモールド作業を完了する。

とのような実施例によれば、ヘッダ下面がキャビティの内壁に密着した状態でレジンモールドするととから、モールド時にレジンがヘッダ下面とキャビティ内盤との間に流れ込むこともない。この結果、ヘッダへのレジンの付着(レジンフラッユ)も生じることはないので、モールド後に従来行なつていた非生強的作業であるパリ取り作業は不要となる。との結果、工数も減少する。

なか、本発明は前記実施例に限定されない。た とえば、キャピティの質面あるいは上型キャピテ ィの底面 (モールド空間状態では天井となる部分) に被モールド物が接触する場合には、その接触部 に対応するキャピティ面に真空最着孔かよびパッ 特明昭55-3613(3)

キンを設ける。また、本発明のレジンモールド報 量にかける被モールド物は2段構造の被モールド 物を必ずしも対象とはせず、単に被モールド物を モールド空間内に入れ、下型キャピティ上に載る ようなものであつてもよい。

以上のように、本発明のレジンモールド装置に よれば、モールド時にレジンフラッシュは生じな いので、レジンフラッシュ除去作業(パリ取り作 乗)は不要となり廃止できる。このため、工数が 少なくなり、製造コストの軽減化を図ることがで

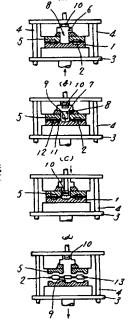
# 図面の簡単な説明

第1回(4)~(9)はモールド機のモールド動作を示す説明図、第2回(4)~(9)は本発明のモールド機が対象とするモールド製品の斜視図、第3回はーモールド製品の新面図、第4回は本発明のモールド機にかける下型の一部を示す斜視図、第5回は同じくモールド状態を示す一部断面図である。

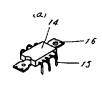
1 ・・下金屋、2 ・・リードフレーム、8 ・・ 浮動盤、4 ・・支柱、5 ・・上金盥、6 ・・投入

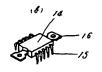
您、7・・タブレット、8・・ポット、8・・カル、10・・ブランジヤ、11・・ランナ、12・・モールド空間、13・・モールド物、14・・モールド部、15・・リード、16・・ヘッダ、17・・下型、18・・ランナ、19・・サヤビテイ、20・・サブランナ、21・・エブーペント、22・・真空吸着孔、28・・エジエタをビン、24・・パッキン、25・・ヘッダ、26・・回略素子、27・・リード、29・・ワイヤ、30・・上型、31・・溶敵レジン。

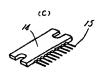
## 代理人 弁理士 荐田 利 幸



# 第 2 段









特開昭55-3613(4)

## 第 3 図

